## NUBIC知的財産情報開示

開示日: 2009年07月24日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。 尚, NUBICベンチャークラブ特別会員,一般会員にはすでにお知らせしています。

	NUBIC管理番号: 2008000106 整理番号 11372 担 当 者 小森 幹雄
表題	LFプラズマジェット生成方法とLFプラズマジェット生成装置
技術分野	電気・電子 機械・加工
適用製品	大気圧中での窒化材料生成や炭素系皮膜形成のためのプラズマ源
目 的	一般にヘリウムのみで放電可能とされたLFジェットを他のガスにも適用し,幅広い応用に適するプラズマ源を提供する。
	大気圧中で簡便にプラズマジェットを生成できるLFジェットはヘリウムを動作ガスとして液中殺菌、ナノ粒子合成、バイオマテリアル表面処理などに応用されてきたが、他のガスにおいては放電が安定せず、実用化はされていなかった。本発明では、新たな予備電離方法を開発することで、アルゴン等大気圧中で電離エネルギーの高いガスについてLFジェットの形成を可能とし、応用範囲を広げることに成功した。
技術移転等	をご希望の場合は,下記事項をご記入の上,本用紙にてお申込みください。
(FAX, e-ma	ail, 郵送いずれでも可。)
各担当コー <sup>、</sup> 面談希望日明	ディネーターからご連絡を差し上げます。 寺「
(ふりがな	
氏 4	
会社组	名
所原	後職
電話番号	FAX番号
E-ma	ail
連絡事項	Į į



【申込み・問い合わせ先】 日本大学産官学連携知財センター(NUBIC) 〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館 TEL:03-5275-8139 FAX:03-5275-8328 E-mail:nubic@nihon-u.ac.jp